Matériaux piézoélectriques intégrés sur silicium

sous la direction de Emmanuel Defaÿ

EGEN

bermes

Lavoisier

Table des matières

Préface	1
Introduction générale Emmanuel Defaÿ	21
Chapitre 1. Diélectrique, piézoélectrique, pyroélectrique et ferroélectrique	23
1.1. Structure cristalline	23
1.1.1. Cristal = réseau + motif	23
1.1.2. Sept réseaux primitifs – Quatorze réseaux de Bravais	26
1.1.3. Deux cent trente groupes d'espace.	27
1.1.4. Trente-deux groupes ponctuels (ou classes cristallines)	28
1.1.5. Les plans réticulaires	30
1.1.6. Les rayons X « voient » le cristal.	31
1.2. Définitions piézoélectricité, pyroélectricité, ferroélectricité	1200
1.3. Exemples simplifiés.	31
1.3.1. Effet diélectrique	33
1.3.2. Effet piézoélectrique	33
1.3.3. Effet pyroélectrique.	34
1.3.4 Effet ferroélectrique	36
1.3.4. Effet ferroélectrique 1.3.5. Effet électrostrictif	37
Effet electrostrictif	3.8

10	Matériaux piézoélectriques	intégrés	sur silicium

1.4. Trois structures typiques : wurtzite, ilménite et pérovskite	39
1.4.1. Structure wurtzite	39
1.4.2. Structure ilménite	40
1.4.3. Structure pérovskite	42
1.5. Bibliographie	47
Chapitre 2. L'étude thermodynamique : une approche structurante Emmanuel DEFAŶ	49
	49
2.1. Historique	51
2.2. Rappel de thermodynamique statistique	51
2.2.2. Notion d'équilibre, postulat statistique	51
2.2.3. Nombres d'états accessibles d'un système	53
2.2.4. Variation d'énergie – Travail et chaleur.	55
2.2.5. L'échange thermique : entropie et température absolue	57
2.2.6. L'énergie thermique : transfert de chaleur	60
2.2.7. Transformation quasistatique avec échange de travail	
at de chaleur	62
2.2.8. Exemple d'une expérience à température et pression constante.	64
2.3. Les fonctions d'états	66
2 4 Fauations linéaires – Piézoélectricité	70
2.5 Equations non linéaires – Electrostriction	72
2.6. Bibliographie	73
Chapitre 3. Modélisation thermodynamique	75
de la transition de phase ferroélectrique-paraélectrique	10
Emmanuel Defaÿ	
3.1. Hypothèse sur l'énergie élastique de Gibbs	75
3.2 Transition du deuxième ordre	78
3.3. Effet des contraintes	84
3.4. Transition du premier ordre	86 91
3.5. Conclusion	91
3.6. Bibliographie	91
	93
Chapitre 4. Formalisme mécanique	
4.1. Introduction	93
4.2. La loi de Hooke	94

Table des matières	11
4.3. Définitions des déformations locales	95
4.3.1. Déformations locales dans l'hypothèse des petites déformations.	95
4.3.2. Signification de la matrice \overline{S}	101
4.4. Définition des contraintes locales	103
4.4.1. Le tenseur des contraintes	103
4.4.2. Signification physique des T _{ij}	106
4.4.3. Equations du mouvement dans un solide déformable	108
4.5. Relation contraintes-déformation	109
4.5.1. Loi de Hooke généralisée	109
4.5.2. Relation dynamique	110
4.6. Densité d'énergie élastique.	112
4.6.1. Expression de la densité d'énergie élastique	112
4.6.2. Symétrie du tenseur d'élasticité	113
4.7. Expression du tenseur d'élasticité en fonction des éléments	110
de symétrie	114
4.8. Bibliographie	118
nor Biologiaphic Control of the Cont	110
Chapitre 5. Formalisme diélectrique	119
Emmanuel Defaÿ	
5.1. Introduction	119
5.2. L'effet diélectrique vu par Faraday	119
5.3. La polarisation et le déplacement électriques	123
5.4. La constante diélectrique	128
5.5. Le champ local dans les diélectriques : la catastrophe	
de la polarisation	129
5.6. La relaxation diélectrique	133
5.6.1. Les diverses relaxations	133
5.6.2. Les relations de Kramers-Kronig	136
5.7. Densité d'énergie électrique	139
5.8. Bibliographie	141
Jo. Biolographic	
	1.42
Chapitre 6. Formalisme piézoélectrique	143
Emmanuel Defay et Mathieu Pijolai	
6.1. Equations thermodynamiques	143
6.2. Réduction des cœfficients par la symétrie des cristaux	145
6.2.1. Exemple de calcul : groupe ponctuel 3m	146
6.3. Modèle microscopique unidimensionnel	150
6.4. Cœfficient de couplage électromécanique	154
6.5. Cœfficients piézoélectriques de certains matériaux	158

12	Matériaux piézoélectriques intégrés sur silicium	
	6.6. Calcul du couplage en fonction de l'orientation cristalline6.7. Cœfficients piézoélectriques dans le cas	160
	des matériaux ferroélectriques	162
	6.8. Bibliographie	163
	napitre 7. Formalisme acoustique	165
	7.1. Propagation d'ondes de volume	165
	7.1.1. Propagation d'ondes de volume dans un milieu élastique	165
	7.1.2. Propagation d'ondes élastiques dans un milieu piézoélectrique.	175
	7.2. Résonateur à ondes de volume	185
	7.2.1. Vibration d'une plaque piézoélectrique	185
	d'impédance acoustique arbitraire	194
	7.2.3. Plaque bimorphe	195
	7.2.4. Plaque piézoélectrique entre deux électrodes	199
	7.2.5. Schéma électrique équivalent	203
	7.3. Filtre à ondes acoustiques de volume	207
	napitre 8. Formalisme électrostrictif	213
	8.1. Fondements de l'électrostriction	213
	8.2. Modèle thermodynamique de l'électrostriction – Cas du résonateur	
	8.3. Le tenseur d'électrostriction	213 215 217
	8.4. Modèle microscopique de l'électrostriction	219
	8.4.1. Modèle unidimensionnel	219
	8.4.2. Origine de la polarisation spontanée	
	dans les cristaux pérovskites	221
	8.5. Résonateur électrostrictif	224
	8.6. Bibliographie	227
	napitre 9. Caractérisation électrique	229
	9.1. Caractérisation piézoélectrique statique des couches minces	229
	9.1.1. Notion de cœfficients effectifs	229
	9.1.2. Caractérisation piézoélectrique du cœfficient e_{3Ieff}	230
	9.1.3. Modèle	232
	9.1.4. Exemple de caractérisation : couches de PZT	235

Table des matières	13
9.2. Le microscope à force atomique piézoélectrique (PFM) 9.2.1. L'AFM 9.2.2. Le PFM 9.3. La mesure ferroélectrique 9.3.1. Montage Sawyer-Tower 9.3.2. Montage « masse virtuelle ». 9.4. La mesure diélectrique 9.5. Courant de fuite dans les structures métal/isolant/métal. 9.5.1. Contact métal/isolant : définitions 9.5.2. Mécanismes de conduction limitée par les interfaces 9.5.3. Mécanismes de conduction limitée par le volume 9.6. Bibliographie	237 237 240 247 249 251 255 258 259 262 265 268
Chapitre 10. Résonateurs et filtres piézoélectriques	271
10.1. Résonateurs acoustiques : principe et historique 10.1.1. Résonateurs à quartz 10.1.2. Montée en fréquence des résonateurs 10.1.3. Perfectionnement des résonateurs FBAR et SMR 10.2. Technologie BAW 10.2.1. Introduction 10.2.2. Les topologies de filtres BAW 10.2.3. Les paramètres du résonateur BAW et leur impact sur la réponse des filtres 10.2.4. Exemples de réalisations 10.3. Technologie CRF 10.3.1. Introduction 10.3.2. Principes de fonctionnement des filtres CRF 10.3.3. Exemple de réalisations	271 271 274 278 292 292 293 296 304 306 307 311
10.4. Bibliographie	314
Mathieu PIJOLAT, Chrystel DEGUET et Sylvain BALLANDRAS 11.1. A propos des HBAR	319 320 321 321

14 Matériaux piézoélectriques intégrés sur silicium

11.2. Technologie 11.2.1. Contraintes technologiques 11.2.2. Choix des matériaux 11.2.3. Géométrie des résonateurs 11.3. Exemples de réalisations 11.3.1. LNO sur LNO 11.3.2. Validation de l'extraction de paramètres : LNO	324 324 325 326 327 327
sur Si HBAR/FBAR	332
11.4. Conclusion sur les HBAR	335
11.5. Bibliographie	335
Chapitre 12. Résonateurs électrostrictifs	337
12.1. Introduction	337
12.2. Etat de l'art	338
12.2.1. Introduction	338
12.2.2. Formalisme du résonateur électrostrictif	340
12.3. Réalisations expérimentales	348
12.3.1. Résonateur BST 70/30 sans isolation acoustique	348
12.3.2. Résonateur STO sur miroir de Bragg	356
12.3.3. Résonateur BST sur miroir de Bragg acoustique	360
12.3.4. Résonateur BST sur membrane	362
12.4. Simulation de filtre avec résonateurs électrostrictifs	363
12.5. Statut sur les résonateurs électrostrictifs pérovskites	364
12.6. Résonateur acoustique ferroélectrique à fréquence accordable	
à base de PZT	366
12.6.1. Introduction	366
12.6.2. Technologie	367
12.6.3. Caractérisation RF et discussion	368
12.7. Effet non linéaire dans l'AlN piézoélectrique	371
12.7.1. Introduction	371
12.7.2. Modèle phénoménologique piézoélectrique-électrostrictif	371
12.7.3. Application : résonateur AlN sur miroir de Bragg	373
12.7.4. Conclusion sur l'AlN non linéaire	376
12.8. Conclusion sur l'électrostriction	377
12.9 Bibliographie	377

atthieu CUEFF, Patrice REY, Fabien FILHOL et Emmanuel DEFAŸ
13.1. Introduction
13.2. Etat de l'art
13.3. Membranes résonantes
13.3.1. Technologie des membranes résonantes en PZT
13.3.2. Caractérisation en fréquence des membranes
13.3.3. Un capteur de pression résonant
13.3.4. Conclusion sur l'étude des membranes résonantes Si/PZT
13.4. Micromiroir résonant
13.4.1. Introduction
13.4.2. Technologie et conception du micromiroir résonant
13.4.3. Caractérisation des dispositifs
13.4.4. Conclusion sur le micromiroir
13.5. Micro-interrupteur piézoélectrique
13.5.1. Intérêt des couches piézoélectriques
pour les micro-interrupteurs
13.5.2. Description générale du composant
13.5.3. Développement analytique de la poutre bilame
comme actionneur de micro-interrupteur
13.5.4. Empilement choisi pour l'actionneur piézoélectrique
13.5.5. Modèle analytique multicouche
13.5.6. Effet de la compensation en température
13.5.7. La couche piézoélectrique
13.5.8. Libération de la membrane
13.5.9. Caractérisations électriques
13.6. Signe des cœfficients piézoélectriques
13.7. Bibliographie